

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成19年12月6日(2007.12.6)

【公表番号】特表2003-514056(P2003-514056A)

【公表日】平成15年4月15日(2003.4.15)

【出願番号】特願2001-535466(P2001-535466)

【国際特許分類】

C 08 G	64/00	(2006.01)
C 08 J	5/00	(2006.01)
C 08 J	5/18	(2006.01)
C 08 L	69/00	(2006.01)

【F I】

C 08 G	64/00	
C 08 J	5/00	C F D
C 08 J	5/18	
C 08 L	69:00	

【手続補正書】

【提出日】平成19年10月19日(2007.10.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】 200μm押出成形フィルムで測定される欠陥濃度が1m²当たり250個以下であるポリカーボネート基体。

【請求項2】 請求項1記載のポリカーボネート基体を出発基体として用いる、欠陥の数が少ないポリカーボネート成形部材の製造方法。

【請求項3】 200μm押出成形フィルムで測定される欠陥の数が1m²当たり250個以下である、ポリカーボネートから製造される成形部材。

【請求項4】 200μm押出成形フィルムで測定される欠陥の数が1m²当たり250個以下および暦り値が0.5%以下であるポリカーボネートを用いて製造されるディスク。

【請求項5】 200μm押出成形フィルムで測定される欠陥の数が1m²当たり250個以下および暦り値が0.5%以下であるポリカーボネートを用いて製造されるシート。